

## X線回折装置 (XRD) (リガク : Smart Lab)

1次元X線検出器 (D/teX Ultra 250) により高速測定が可能です。

粉体試料の $\theta$ - $2\theta$ X線回折のほか、光学パーツを組み替えることで薄膜試料のロックングカーブ解析、逆格子マップ、極点、インプレーン回折、反射率解析、小角散乱など多様な薄膜評価手法に対応します。

また、測定データの解析には、PDXL2、ICDD、NANO-Solver、3D Explore、GlobalFitがインストールされています。

※B-051 (X線回折装置解析PC) にも、これらのソフトウェアが導入されていますので、解析に長時間かかる場合にご利用ください。



### 【仕様】

<b>X線管球</b>	銅 (回転対陰極式)
<b>最大定格出力</b>	45kV、200mA (9kW)
<b>最小ステップ</b>	0.0001°
<b>ゴニオメータ半径</b>	300mm
<b>光学系</b>	CBO光学系切り替えユニット (集中法、平行ビーム法)
<b>ステージ</b>	標準粉末用高さ基準試料板、透過小角用試料板、4インチウェーハ用試料板
<b>検出器</b>	シンチレーションカウンタ、1次元半導体検出器 (D/teX Ultra 250)
<b>その他</b>	Cu用カウンタモノクロメータユニット (シンチレーションカウンタ用) Cu-K $\beta$ 用フィルター

**設置場所** C10棟 215室

**カテゴリー** 計測